

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第166回研究会プログラム

日時：2019年12月12日(木) 13:00～

場所：明治大学 駿河台キャンパス (グローバルフロント 1F 多目的室)

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

テーマ：「結晶薄化のための加工技術・評価技術」

世話人：佐野 泰久 (大阪大学)、閻 紀旺 (慶應義塾大学)

プログラム：

- | | | |
|-------------|--|---------------------|
| 13:00～13:05 | 開会の挨拶 | 柿本 浩一 |
| 13:05～13:10 | はじめに | 佐野 泰久 |
| 13:10～13:50 | 「Si 裏面薄化技術の現状と課題」(仮) | 石川 一政 (東京精密) |
| 13:50～14:30 | 「Si 蒸気下での熱エッチングによる SiC の無歪薄化」(仮) | 鳥見 聡 (東洋炭素) |
| 14:30～15:10 | 「熔融 KOH による SiC の高速鏡面加工法」(仮) | 池野 順一 (埼玉大学) |
| 15:10～15:25 | 休憩 | |
| 15:25～16:05 | 「高圧力プラズマを用いたエッチングによる Si・SiC 単結晶の無歪薄化」(仮) | 佐野 泰久 (大阪大学) |
| 16:05～16:45 | 「薄ウエハの形状計測技術ならびに反りデータを用いた残留応力の推定」(仮) | 桑原 啓 (神津精機) |
| 16:45～17:25 | 「分光干渉法による高能率高精度厚さ分布測定」(仮) | 近藤 孝司 (JFE テクノリサーチ) |
| 17:25～17:30 | おわりに | 閻 紀旺 |
| 17:40～19:30 | 意見交換会 (グローバルフロント 17F グローバルラウンジ) | 以上 |